

## ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Зайченко А.Н.

«Физико-технологические основы термомиграционного легирования  
микрообластей в объёме кремния акцепторными примесями»,  
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по  
специальности 2.2.3 «Технология и оборудование для производства  
материалов и приборов электронной техники»

В технологии изготовления полупроводниковых приборов и материалов электронной техники широкий круг задач решается методом термомиграции (ТМ). Метод ТМ позволяет локально перекристаллизовывать кремниевые пластины, создавая в них сквозные каналы. Методу свойственны высокие скорости роста, экологичность и сравнительно низкие температуры реализации. Однако, как показали экспериментальные исследования доктора физико-математических наук, известные методики, на которых основан метод ТМ, демонстрируют невысокую воспроизводимость перекристаллизации, связанную прежде всего с обилием процессов и факторов, сопровождающих термомиграционное легирование. Вследствие чего основной задачей докторской работы ставилась разработка основ воспроизводимой технологии термомиграционного легирования, включая соответствующее аппаратурное оформление.

К наиболее существенным научным результатам работы можно отнести: разработку термомиграционного легирования кремния алюминием, галлием или их сплавами, позволяющего воспроизводимо создавать в монокристаллических пластинах диаметром 100 мм систему микрообластей в виде сквозных каналов с концентрацией акцепторов в диапазоне  $(1-4) \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ ; обнаружение эффекта независимости скорости легирования кремния от концентрации галлия и алюминия при температуре в интервалах 1400–1420 К, что позволяет прецизионно управлять конфигурацией микрообластей; выявление высокого кристаллического совершенства полученных сквозных каналов; обоснование и разработку структуры фотоэлектрического преобразователя с

использованием сквозных вертикальных *p*-каналов, обеспечивающего повышение эффективности преобразования энергии.

В качестве замечания, выявленного из автореферата, можно отметить отсутствие конкретики о программном продукте, посредством которого осуществлялось компьютерное моделирование, позволившее выявить влияние охранного кольца нагревателя на конфигурацию теплового поля. Также автореферат содержит опечатки и стилистические неточности.

На основании материала, изложенного в автореферате, считаю, что диссертационная работа «Физико-технологические основы термомиграционного легирования микрообластей в объеме кремния акцепторными примесями» отвечает Положению о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Южный федеральный университет», а её автор Заиченко Александр Николаевич, заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата технических наук по специальности 2.2.3 «Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники».

Профессор кафедры «Высшая математика»  
ФГБОУ ВО ДГТУ, д-р техн. наук



Князев Сергей  
Юрьевич

Доцент кафедры МиТМ  
ФГБОУ ВО ДГТУ, канд. техн. наук



Щербакова Елена  
Евгеньевна

*Согласны на обработку наших персональных данных*  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Донской государственный технический университет»  
Юридический (фактический) адрес:  
344003, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пл. Гагарина, д. 1,  
тел. 8 (928)-757-08-25, e-mail: [ksy-1951@mail.ru](mailto:ksy-1951@mail.ru)

Подпись Князева С.Ю. и  
Щербаковой Е.Е. заверяю:



Ученый секретарь ДГТУ  
Анисимов В.Н.  
05.12.2023